

※課題番号 : F-12-KT-0122  
※支援課題名 (日本語) : Si 加工技術開発  
※Program Title (in English) : Si process technology development  
※利用者名 (日本語) : 松崎 栄  
※Username (in English) : Sakae Matsuzaki  
※所属名 (日本語) : 株式会社 ディスコ  
※Affiliation (in English) : DISCO Inc.

※概要 (Summary) :

【相談内容】

Si 基板に対する高アスペクト加工の新規技術開発の  
為、ナノハブ装置を利用したい。

希望利用装置

- ・ 電子顕微鏡
- ・ 3D レーザー顕微鏡
- ・ 触針式段差計

【回答】

上記の装置群を利用して希望するデータ  
を得る事が可能。

【結果】 H25 年度自主事業として利用を計画。

※実験 (Experimental) :

技術相談の為割愛

※結果と考察 (Results and Discussion) :

技術相談の為割愛

※その他・特記事項 (Others) :

なし